

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 2 部門第 3 区分
【発行日】平成 16 年 12 月 24 日 (2004.12.24)

【公開番号】特開 2001-9713 (P2001-9713A)
【公開日】平成 13 年 1 月 16 日 (2001.1.16)
【出願番号】特願 平 11-185357
【国際特許分類第 7 版】

B 2 4 B 37/04
H 0 1 L 21/304

【F I】

B 2 4 B 37/04 Z
H 0 1 L 21/304 6 2 2 L

【手続補正書】

【提出日】平成 16 年 1 月 19 日 (2004.1.19)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

研磨面を有した研磨テーブルと、研磨対象物を保持しかつ研磨対象物を前記研磨面に押圧する少なくとも二個のトップリングとを有した研磨処理部を備え、前記少なくとも二個のトップリングはそれぞれ揺動軸により支持され、研磨テーブル上で研磨対象物の研磨を行う研磨位置と研磨対象物を受け渡しする受け渡し位置との間を移動可能になっており、前記少なくとも二個のトップリングは前記研磨位置に同時に位置することができることを特徴とするポリッシング装置。

【請求項 2】

前記研磨面のドレッシングを行うドレッサーを備えたことを特徴とする請求項 1 記載のポリッシング装置。

【請求項 3】

前記トップリングおよびドレッサー毎に液体供給用のノズルが設けられていることを特徴とする請求項 2 記載のポリッシング装置。

【請求項 4】

前記受け渡し位置にはトップリングとの間で研磨対象物の受け渡しを行うためのロードアンロード兼用ブッシャが配置されていることを特徴とする請求項 1 記載のポリッシング装置。

【請求項 5】

一つのロードアンロード兼用ブッシャと一つのトップリングを対応させ、その組合せを一つの研磨テーブルに対し 2 組以上持つことを特徴とする請求項 4 記載のポリッシング装置。

【請求項 6】

一つのロードアンロード兼用ブッシャで二つのトップリングとの間で、研磨対象物を受け渡し可能としたことを特徴とする請求項 4 記載のポリッシング装置。

【請求項 7】

第一のトップリングが前記研磨位置で研磨している最中に、第二のトップリングが前記受け渡し位置で研磨対象物を受け取った後待機し、第一のトップリングによる研磨終了と同時に、第二のトップリングによる研磨を行うことができる第一の研磨方法と、第一のトッ

ブリングが前記研磨位置で研磨している最中に、第二のトップリングが前記研磨位置で第二の研磨対象物の研磨を行うことができる第二の研磨方法を選択可能であることを特徴とする請求項 1 記載のポリッシング装置。

【請求項 8】

前記第二の研磨方法において、第一のトップリングと第二のトップリングで異種材料を表面に有した研磨対象物を研磨し、第二のトップリングによる第二の研磨時間が第一のトップリングによる第一の研磨時間と同じかそれより短いことを特徴とする請求項 7 記載のポリッシング装置。

【請求項 9】

複数の研磨処理部を有することを特徴とする請求項 1 乃至 8 のいずれか 1 項に記載のポリッシング装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0008】

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するため、本発明は、研磨面を有した研磨テーブルと、研磨対象物を保持しかつ研磨対象物を前記研磨面に押圧する少なくとも二個のトップリングとを有した研磨処理部を備え、前記少なくとも二個のトップリングはそれぞれ揺動軸により支持され、研磨テーブル上で研磨対象物の研磨を行う研磨位置と研磨対象物を受け渡しする受け渡し位置との間を移動可能になっており、前記少なくとも二個のトップリングは前記研磨位置に同時に位置することができることを特徴とするものである。